

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 6 部門第 1 区分
【発行日】令和 3 年 5 月 20 日 (2021.5.20)

【公開番号】特開 2020-153724 (P2020-153724A)
【公開日】令和 2 年 9 月 24 日 (2020.9.24)
【年通号数】公開・登録公報 2020-039
【出願番号】特願 2019-50689 (P2019-50689)
【国際特許分類】

G 0 1 N 23/20008 (2018.01)

G 0 1 N 23/207 (2018.01)

G 0 1 N 23/201 (2018.01)

【F I】

G 0 1 N 23/20008

G 0 1 N 23/207

G 0 1 N 23/201

【手続補正書】

【提出日】令和 3 年 4 月 6 日 (2021.4.6)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

第 1 の方向に延伸する入射側アームと固定部と受側アームとを備えるゴニオメータと、
前記入射側アームに配置され、前記第 1 の方向に交差する第 2 の方向に延伸するX 線ビームを発生させるX 線源と、
前記固定部に配置され、試料を支持する支持台と、
前記固定部に配置され、前記X 線源より発生する前記 X 線ビームの前記第 2 の方向に沿う線幅を制限する平行スリットと、
前記受側アームに配置され、前記試料より発生する散乱 X 線を検出する検出器と、
を備える、X 線分析装置。

【請求項 2】

請求項 1 に記載の X 線分析装置であって、
前記平行スリットを前記第 2 の方向に移動させる移動機構を備える、
ことを特徴とする、X 線分析装置。

【請求項 3】

請求項 1 又は 2 に記載の X 線分析装置であって、
前記平行スリットは、中空円の一部となる形状を有する、
ことを特徴とする、X 線分析装置。